

Title (en)
VACUUM PUMP AND VACUUM PUMP SYSTEM

Title (de)
VAKUUMPUMPE UND VAKUUMPUMPENSYSTEM

Title (fr)
POMPE À VIDE ET SYSTÈME DE POMPE À VIDE

Publication
EP 3845764 A2 20210707 (DE)

Application
EP 21166257 A 20210331

Priority
EP 21166257 A 20210331

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vakuumpumpe, insbesondere Turbomolekularvakuumpumpe, mit einem Einlass, einem Auslass, einem Gehäuse, das einen Pumpenraum für ein vom Einlass zum Auslass in einer Pumprichtung zu pumpendes Gas einschließt, und zumindest einer Holweck-Pumpstufe, die zumindest einen Holweck-Stator und wenigstens einen im Betrieb um eine Rotationsachse rotierenden, zusammen mit dem Holweck-Stator einen Holweck-Pumpbereich begrenzenden Holweck-Rotor umfasst, wobei der Holweck-Pumpbereich bezogen auf die Rotationsachse eine axiale Länge mit einem ersten axialen Ende und einem zweiten axialen Ende aufweist, wobei zumindest ein weiterer Einlass für zu pumpendes Gas vorgesehen ist, der über einen Einlasskanal zu einer im Holweck-Stator ausgebildeten Mündung des weiteren Einlasses in den Holweck-Pumpbereich führt, wobei die Mündung in axialer Richtung zwischen dem ersten axialen Ende und dem zweiten axialen Ende des Holweck-Pumpbereiches gelegen ist, und wobei der Einlasskanal zumindest einen Mündungsabschnitt umfasst, der im Holweck-Stator ausgebildet ist und bis zur Mündung in den Holweck-Pumpbereich führt.

IPC 8 full level
F04D 1/00 (2006.01)

CPC (source: EP)
F04D 19/042 (2013.01); **F04D 19/044** (2013.01); **F04D 19/046** (2013.01); **F04D 25/08** (2013.01); **F04D 29/522** (2013.01)

Designated contracting state (EPC)
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR

Designated extension state (EPC)
BA ME

DOCDB simple family (publication)
EP 3845764 A2 20210707; **EP 3845764 A3 20211027**; **EP 3845764 B1 20230503**

DOCDB simple family (application)
EP 21166257 A 20210331